–	主要な機能 その他	利用条件	担当者(内線)	詳細情報
装置名	や仕様 特記事項	利用形態 運転・保守費用 その他 の概略 条件	研究室名	(ページ)

Ⅱ. 形状観察・構造解析・物性計測のための装置

2-1. 顕微鏡観察

表面調整観察装置、STM装置			クラスター	
分子線エピタキシー(MBE)/走査型トンネ			半導体	
ル顕微鏡システム	 		十等件	
高温試料加熱ステージ付マルチモードSPMシステム			情報記録機能材料	
SPMコントロール(インターフェース付)			表面科学	
SPMコントローラ			表面科学	
走査トンネル顕微鏡			表面科学	
走査型プローブ顕微鏡システム			表面科学	
超高真空STM/AFM装置			表面科学	
走査電子顕微鏡			界面制御プロセス	
SEM付属用元素分析装置			界面制御プロセス	
走査電子顕微鏡			界面制御プロセス	
走査型電子顕微鏡			光機能物質	
走査型電子顕微鏡			半導体	
電界放射走査電子顕微鏡			情報記録機能材料	
電界放出走査電子顕微鏡			表面科学	
高温顕微鏡			半導体	
コンフォーカル顕微鏡			半導体	
デジタルマイクロスコープ			機械創成	
デジタルマイクロスコープ(コントローラー)			固体力学	
リアルサーフェスビュー顕微鏡			機械創成	
高分解能磁気解析電子顕微鏡			情報記録機能材料	
電子顕微鏡画像記録処理装置			情報記録機能材料	
透過型電子顕微鏡(含高速TEMオンアクシスカメラ			半導体	
システム)	 			
オンフランジ型光電子顕微鏡			表面科学 量子界面物性	
in situ局所構造評価装置			里丁介凹彻注	

	主要な機能をの他		利用条件			担当者(内線)	詳細情報
装置名	工安な機能	特記事項	利用形態	運転·保守費用		ロ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	計権情報(ページ)
	, 1–144	1345 3 20	13713712744	の概略	条件	717022 F	
高分子材料解析システム						極限高分子材料	
高温X線小角散乱測定装置	ā					フロンティア材料	
X線分析装置						半導体	
						表面科学	
エネルギー分散形X線分析装置	ā					表面科学	
	•						<u> </u>
2-3. 光学物性計測・分光分析							
Nd:YAGレーザー						クラスター	
Nd:YAGパルスレーザーシステム						界面制御プロセス	
パルスNd:YAGレーザー						表面科学	
高出力グリーンレーザー						クラスター	
原子・分子解析レーザー/近紫外						クラスター	
20WグリーンYLFレーザー						クラスター	
フェムト秒レーザー再生増幅器						クラスター	
CW波長可変Ti∶サファイアレーザ						ナノ電子工学	
LD励起CWグリーン固体レーザー						量子界面物性	
エキシマレーザー						フロンティア材料	
アルゴンイオンレーザー						フロンティア材料	
波長可変レーザ光源						フロンティア材料	
自動波長可変レーザーシステム						量子界面物性	
波長可変ナノ秒可変レーザー						量子界面物性	
パルスレーザー						量子界面物性	
高出力クリーンレーザー						光機能物質	
ファイバーレーザ						光機能物質	
レーザーPN分離装置	ā						
レーザ光高速変調装置						光機能物質	
中赤外短パルスレーザシステム						光機能物質	
高出力短パルスレーザ光源	d					光機能物質	
高温真空紫外分光装置						フロンティア材料	
中赤外光学パラメトリック発振器						クラスター	
MCTアレイ赤外線検出器						量子界面物性	
レーザーラマン分光光度計用冷却加熱装置						フロンティア材料	
高出力レーザーラマン分光装置						光機能物質	
同山ガレーリーノマンガル表直 顕微ラマン	()					表面科学	
 						<u> </u>	
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			光機能物質	
光分散アナライザ					0	光機能物質	
ソーラシミュレータ						半導体	
デジタルCCD分光検出器						クラスター ル 46 45 45 55	
短波長帯光スペクトラムアナライザ						光機能物質	
プリフォームアナライザ						フロンティア材料	
超高分解能スペクトロメーター						光機能物質	
スーパーコンティニュアム光源						光機能物質	
超短光パルス光源	d					光機能物質	
ラジカルビーム源	d					半導体	
温度可変オプティスタット						半導体	
高分解能フォトルミネッセンス測定						半導体	

装置名	主要な機能	その他	利	用条件		担当者(内線)	詳細情報
	や仕様	特記事項	利用形態	運転・保守費用 の概略	その他 条件	研究室名	パージ)
顕微フォトルミネッセンス装置						半導体	
時間分解フォトルミネッセンス装置						半導体	
X線光電子分光装置						表面科学	
光電子顕微鏡用エネルギーアナライザー						表面科学	
高速蛍光寿命測定装置						量子界面物性	
超高速非線形応答特性評価装置						量子界面物性	
ピコ秒波長可変器						量子界面物性	
ナノ秒波長可変システム						クラスター	
光雑音測定装置						光機能物質	
シンセサイズド・スイーパ						光機能物質	
光干渉式膜厚計						マイクロメカトロニクス	
光学測定用4K冷凍機システム						光機能物質	
フレーム原子吸光装置						高分子ナノ複合材料	

2-4. 電気物性・磁気物性計測

半導体特性評価システム			半導体	
ICTS測定装置(Isothermal Capacitance			半導体	
Transient Spectroscopy)			十等件	
エレクトロントラップ測定システム			半導体	
高倍率磁区観察装置			情報記録機能材料	
680nm光一磁気記録再生評価装			情報記録機能材料	
超高密度光磁気記録材料評価装置			情報記録機能材料	
超広帯域磁気-光効果測定装置			情報記録機能材料	
GMRヘッドスピンスタンド装置			情報記録機能材料	
ベクトルシグナルアナライザー			光機能物質	
マイクロ波光源および信号検出装置			フロンティア材料	
広帯域オシロスコープ			光機能物質	
高感度光子計測装置			光機能物質	
分光感度測定装置			半導体	
高精度GPS			スマートビークル研究センター	

2-5. 化学的性質および量子物性計測

エクストレル四重極質量分析計用電			クラスター	
四重極質量分析装置(四重極マスフィルタ)			クラスター	
質量分析計			クラスター	
ライフタイム測定装置			半導体	
量子効率測定装置			光機能物質	
LEED/AES装置			表面科学	
オージェ電子分光装置			表面科学	
加熱機構付きアッシャー装置			マイクロメカトロニクス	
全自動元素分析装置			高分子ナノ複合材料	
窒素分析装置			材料プロセス	
電子スピン共鳴装置			半導体	
電子プローブマイクロアナライザ			材料プロセス	

2-6. その他の物性計測

高温型示差走査熱量計			フロンティア材料	
差動形高温形TG-DTA			量子界面物性	
極低温光交流法比熱測定装置			フロンティア材料	
表面形状測定器			マイクロメカトロニクス	
非接触3次元表面形状・粗さ測定装置			マイクロメカトロニクス	

装置名	主要な機能	その他	利用条件 担当者(内線)		担当者(内線)	詳細情報	
	や仕様	特記事項	利用形態	運転・保守費用 の概略	その他 条件	研究室名	(ページ)
触針式表面形状測定器						半導体	
4ch3次元音響インテンシィティ						流体工学	
変位振動測定装置						機械創成	
原子層モニター装置						表面科学	
触力覚デバイス						固体力学	
屈折率膜厚測定装置						光機能物質	
2次元レーザー・ドップラー流速計						流体工学	
リアルタイムPIV装置						流体工学	